[Note]

www.whxb.pku.edu.cn

可见光响应 Bi₂WO₆ 薄膜的制备与光电化学性能

张士成^{2*} 姚文清¹ 朱永法^{1*} 施利毅³

(¹清华大学化学系,北京 100084; ²复旦大学环境科学与工程系,上海 200433; ³上海大学纳米科学与技术研究中心,上海 200444)

摘要: 采用非晶态配合物-提拉法在 ITO 导电玻璃基底上制备得到 Bi₂WO₆ 薄膜. 采用 FE-SEM、XRD、Raman、DRS、光电流响应谱、IPCE 等手段, 研究了 Bi₂WO₆ 薄膜的形貌、结构、光电性能以及薄膜结构与光电性能的关系. 结果表明, 450 ℃以上煅烧可以得到 Bi₂WO₆结晶薄膜, 薄膜由沿(131)晶面趋向生长的 Bi₂WO₆ 纳米颗粒组成, 颗粒的粒度随煅烧温度的升高而增大, 同时颗粒之间的间距也相应增大. ITO/Bi₂WO₆ 薄膜电极在可见光(λ>400 nm)照射下可以产生光电流, 光电流强度与光强度线性相关; 光电流强度和光电转换量子效率受 Bi₂WO₆ 薄膜结构的影响, 通过控制薄膜的煅烧温度等制备条件, 可以提高薄膜光电极的光电转换量子效率.

关键词: Bi₂WO₆薄膜; 光电化学; 可见光; 非晶态配合物; 光催化 中图分类号: O646

Preparation and Photoelectrochemical Properties of Bi₂WO₆ Films with Visible Light Response

ZHANG Shi-Cheng^{2,*} YAO Wen-Qing¹ ZHU Yong-Fa^{1,*} SHI Li-Yi³

(¹Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing 100084, P. R. China; ²Department of Environmental Science & Engineering, Fudan University, Shanghai 200433, P. R. China; ³Research Center of Nano-Science and Nano-Technology, Shanghai University, Shanghai 200444, P. R. China)

Abstract: The Bi_2WO_6 films on ITO glass substrates have been prepared from amorphous complex precursor by dipcoating technique. The structure and photoelectrochemical properties of the films were investigated by using FE-SEM, XRD, Raman, DRS, IPCE (incident photon-to-current conversion efficiency) and photocurrent action curves. The crystalline Bi_2WO_6 film could be obtained above 450 °C, which was composed of Bi_2WO_6 nanoparticles growing along (131) face. The size of Bi_2WO_6 nanoparticles was increased with the calcination temperature, and the space between the nanoparticles also increased. Under the visible light ($\lambda > 400$ nm) irradiation, the photocurrent was generated from the ITO/ Bi_2WO_6 photo-electrode, with the photocurrent density linear to the light intensity. The photocurrent density and IPCE can be controlled by modifying the surface structure of Bi_2WO_6 films, which can be achieved by changing the preparation conditions (such as calcination temperature).

Key Words: Bi₂WO₆ films; Photoelectrochemistry; Visible light; Amorphous complex precursor; Photocatalysis

半导体电极可以用于光电催化降解污染物、光电分解水制氢和氧、光电池(太阳能转换)等领域,因此半导体光电极的光电化学是非常重要的研究课题^[1-6].目前研究较多的半导体光电极有 TiO₂、ZnO、SnO₂、Fe₂O₃、CdS、CdSe 等.大部分半导体只能吸收

紫外光,或具有光腐蚀.开发具有可见光吸收(禁带 宽度较小)、性能稳定、成本低廉的半导体光电极,是 非常有意义的.

Bi₂WO₆ 是一种新型的可见光光催化剂, 禁带宽 度为 2.7 eV 左右^[7-12]. 1999 年, Kudo 等^[7]首次报道了

Received: July 3, 2006; Revised: August 1, 2006.

C Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica

^{*}Corresponding author. Email: zhangsc@fudan.edu.cn, Tel: +8621-65642297; Email: zhuyf@tsinghua.edu.cn, Tel: +8610-62787601.

国家自然科学基金(50502022)、上海市纳米科技专项(05nm05019)资助项目

在硝酸银水溶液中利用 Bi₂WO₆ 成功光解水产生 O₃. 随后, Zou 等¹⁸发现在可见光响应下 Bi₃WO₆ 能够 有效地降解氯仿和乙醛等有害物质.我们最近采用 非晶态配合物法和水热法制备了 Bi₂WO₆ 纳米颗粒 和纳米片,通过结构调控使其可见光活性大大提 高[9-12]. 然而, Bi₂WO₆ 薄膜方面的研究主要集中在薄 膜的电性能,如 Hamada 等¹³采用脉冲激光沉积法 在 Nb 掺杂的 SrTiO₃ 基底上沉积 Bi₂WO₆ 薄膜,并研 究了薄膜的介电性质; Ishikawa 等四采用化学气相 沉积法在不同基底上制备得到 Bi₂WO₆ 趋向薄膜, 并研究了薄膜的电学性能.关于 Bi₂WO₆ 薄膜光电 性能方面的研究还未见报道.将 Bi₂WO₆ 薄膜应用 于光电化学领域,将会对太阳光中可见光的利用提 供新的思路和途径.本文采用非晶态配合物法制备 前驱体溶液,然后采用提拉法在 ITO 导电玻璃基底 上制备 Bi₂WO₆薄膜,并研究薄膜光电化学性能.

1 实 验

1.1 Bi₂WO₆ 薄膜的制备

采用非晶态配合物法制备前驱体溶液,经提拉 镀膜、煅烧,得到 Bi₂WO₆薄膜.

前驱体的制备方法与文献[11]相同,将 0.02 mol 二乙三胺五乙酸(H₅DTPA)和 7.5 mL 浓氨水(浓度约 13.0 mol·L⁻¹)加入 200 mL 热的蒸馏水中,搅拌溶 解后,加入 0.005 mol Bi₂O₃和 0.005 mol 5(NH₄)₂O· 12WO₃·5H₂O 粉末,加热至 80 ℃,搅拌溶解,呈无色 透明溶液.然后放入 80 ℃烘箱,慢慢蒸发,制得透明 的玻璃状前驱体.将玻璃状前驱体研磨成粉末,然后 按比例配制成浓度 20%(w)的溶液,即为提拉镀膜的 前驱体溶液.

在 ITO 导电玻璃表面提拉镀膜之前,需要先将 导电玻璃洗涤干净,ITO 导电玻璃的洗涤方法如下: 首先用洗涤剂和去离子水洗涤,然后分别浸入乙醇、 丙酮中超声洗涤 15 min,吹干后,用 11 W 低压汞灯 照射 1 h,最后密闭储存备用.

将洗好的 ITO 导电玻璃放入前驱体溶液中浸 泡 2 min, 以 3 cm·min⁻¹ 的速率提拉镀膜, 在 80 ℃的 烘箱中干燥后, 放入马弗炉中煅烧, 升温速率为 3 ℃· min⁻¹, 升温至预定温度(400、450、500、550 ℃)后, 恒 温 4 h.

1.2 样品表征

薄膜样品形貌采用日立公司的 Hitachi S450型 场发射扫描电镜(FE-SEM)观测.薄膜的晶体结构采

用 Rigaku D/MAX-RB X 射线衍射仪(XRD)检测, Cu K_α靶, 扫描速率 4 (°)·min⁻¹. Raman 光谱采用英国 Renishaw 公司生产的 RM2000 型显微共焦拉曼光 谱仪检测, 激光器波长 514 nm, 激光功率 0.5 mW, 数据收集次数 10 次, 每次 60 s. UV-Vis 漫反射(DRS) 采用日立 U-3010 紫外-可见分光光度计进行检测, 配备积分球附件.

光电化学性能采用自行设计组装的两电极光电 化学性能检测系统进行检测,采用北京畅拓科技有 限公司的 CHF500 型氙灯光源系统(500 W)作为光 源,用 λ>400 nm 的截止滤光片滤掉紫外光,用北京 师范大学光学仪器厂生产的 FZ-A 型辐照计检测光 强;通过单色仪(北京卓立汉光仪器有限公司, SAP301 型光栅单色仪)获得单色光.以ITO/Bi₂WO₆薄膜作 为工作电极,铂片为对电极,电解液为 0.05 mol·L⁻¹ I₂和 0.5 mol·L⁻¹LiI 的碳酸丙稀酯溶液. Bi₂WO₆薄 膜的照光面积为 0.3 cm×0.3 cm.

2 结果与讨论

2.1 Bi₂WO₆ 薄膜的形貌与结构

Bi₂WO₆ 薄膜的形貌见图 1, ITO 导电玻璃表面 有明显的 ITO 颗粒, 粒度约 10 nm, 颗粒排列紧密; 经过提拉镀膜, 在不同温度下煅烧后, 薄膜表面均看 不到类似 ITO 表面的颗粒形貌, 说明提拉镀膜能将 基底表面完全覆盖, 与煅烧温度无关. 400 ℃煅烧得 到的薄膜表面均匀, 无明显的颗粒出现; 450 ℃以上 温度煅烧的薄膜均出现明显的颗粒, 随温度的升高, 颗粒平均粒度呈线性增大, 粒度偏差增大. 不同煅烧 温度下颗粒的平均粒度分别为 450 ℃, 40 nm; 500 ℃, 60 nm; 550 ℃, 75 nm. 由于颗粒粒度的增大, 颗 粒之间的孔隙增大, 颗粒呈孤岛状分布, Bi₂WO₆颗 粒的覆盖率减小(450 ℃, 约 90%; 500 ℃, 约 60%; 550 ℃, 30%).

薄膜的结构采用 XRD 和 Raman 进行表征, 图 2 为薄膜的 XRD 图谱, 图 3 为薄膜的 Raman 光谱. 从 XRD 结果来看, 400 ℃煅烧的薄膜没有形成 Bi₂WO₆ 相, 450 ℃以上温度煅烧的薄膜均形成结晶 较好的 Bi₂WO₆ 相, 这与文献[11]报道制备 Bi₂WO₆ 粉体的结果类似. 但 XRD 衍射峰的强度并不是随 煅烧温度的升高而增强, 而是 450 ℃时的衍射峰最 强. 从 Raman 结果来看, 450 ℃以上煅烧的薄膜均出 现 Bi₂WO₆ 相应的 Raman 散射谱带, 与 Bi₂WO₆ 粉体 的 Raman 光谱符合较好, 进一步证实 450 ℃以上可





以形成 Bi₂WO₆相薄膜.同时,发现 Raman 光谱中 Raman 散射强度随煅烧温度升高而增强,与 XRD 结果存在差别.主要原因是,Raman 光谱的检测深 度较小,不同煅烧温度下的薄膜均未检测出基底 ITO 的 Raman 散射^[15,16],用 Raman 光谱更能反映 Bi₂WO₆ 薄膜的真实结构变化,随温度升高,散射强度增强, 说明随温度的升高,薄膜中的Bi₂WO₆ 相结晶更完 善.而 XRD 检测深度相对较 Raman 光谱大,在所





(a) standard patterns of In₂O₃, JCPDF 44-1087; (b) precursor film
(c) 400 °C; (d) 450 °C; (e) 500 °C; (f) 550 °C;
(g) standard patterns of Bi₂WO₆, JCPDF 79-2381

有样品中都检测到基底 ITO 的 XRD 衍射峰. 随温度的升高, 薄膜中的 Bi₂WO₆ 相结晶更完善, XRD 衍射峰会增强, 另一方面随煅烧温度的升高, Bi₂WO₆ 颗粒增大, 颗粒间隙同时增大, Bi₂WO₆ 颗粒所对应的覆盖面积减小, XRD 衍射峰又有减弱的趋势, 综合考虑, 认为后者起了主导作用. 450 ℃时, Bi₂WO₆ 颗粒的覆盖面积最大, 相应的 XRD 衍射峰最强.

从 XRD 结果(图 2)还可以看出, Bi₂WO₆(131)和



图 3 不同煅烧温度 Bi₂WO₆ 薄膜的 Raman 光谱 Fig.3 Raman spectra of Bi₂WO₆ films prepared with different calcination temperatures

(a) 400 ℃; (b) 450 ℃; (c) 500 ℃; (d) 550 ℃;
 (e) Bi₂WO₆ powder, calcined at 500 ℃



图 4 不同煅烧温度 Bi₂WO₆ 薄膜在可见光照射下的光电 流响应曲线



(262)晶面所对应的衍射峰明显增强,其它衍射峰均 削弱,说明 Bi₂WO₆薄膜沿(131)晶面趋向生长.

2.2 Bi₂WO₆ 薄膜的光电化学性能

以 ITO/Bi₂WO₆ 为工作电极, I-/I₃的碳酸丙稀酯 溶液为电解液, 铂片为对电极, 组装成光电池器件. 图 4 为不同煅烧温度 Bi₂WO₆ 薄膜在可见光照射下 (λ>400 nm, 200 mW·cm⁻²)的光电流响应曲线. 400 ℃ 煅烧得到的薄膜, 由于没有形成 Bi₂WO₆ 晶相(图 2、 3), 没有光电流产生, 因此没有给出光电流响应曲 线. 450、500、550 ℃煅烧得到的薄膜, 均具有很好的 Bi₂WO₆ 晶相, 在可见光照射下能产生较强的光电 流. 光电流的大小与煅烧温度呈非线性关系, 500 ℃ 煅烧的薄膜光电流最强, 这与不同煅烧温度下生成 的 Bi₂WO₆ 薄膜的结构有关.

光电流的产生与光照强度密切相关,图 5 为 Bi₂WO₆薄膜光电流与光强的关系.在光强为 10-200 mW·cm⁻²范围内,光电流与光强具有很好的线 性关系^[17-18],随着光强的增大,光电流线性增大,说明 ITO/Bi₂WO₆薄膜光电极的光电流在该光强范围内 还没有达到饱和.

图 6 为不同煅烧温度薄膜在可见光照射下(λ> 400 nm, 200 mW·cm⁻²)的光电流和单色光转换效率 (IPCE)响应曲线.光电流大小的变化趋势与 Bi₂WO₆ 的吸收光谱基本一致,光电流工作光谱的截止波长 比吸收光谱的截止波长偏小.这可能有两方面原因: 一是长波长光子能量低,激发 Bi₂WO₆ 产生光电子 容易复合,光电流较小,检测不灵敏;二是 Bi₂WO₆ 的吸收光谱实验中存在散射.光电转换量子产率也



图 5 不同煅烧温度 Bi₂WO₆ 薄膜在可见光照射下光电流与 光强度的关系

Fig.5 Effects of light intensity on the photocurrent of Bi₂WO₆ films prepared with different calcination temperatures



与照射光的波长有关, 随波长的减小, 量子效率增大, 但总体来看, 量子效率较小(均小于 0.12). 造成 光电转换量子效率低的原因主要有以下两个. (1) 光 吸收率低. Bi₂WO₆ 薄膜的厚度非常薄, 光的吸收率



图 6 不同煅烧温度 Bi₂WO₆ 薄膜的光电流(a)和 IPCE(b) 作用曲线



较低,而且随着光波长的增大,光的穿透力增强,透 过率增加,吸光率降低,造成随着照射光波长的增 大,光电转换量子效率降低.(2)光生电子的复合率 高.Bi₂WO₆薄膜光电极的光电子复合途径大体包括 以下几种可能,Bi₂WO₆薄膜中的晶体缺陷复合、 Bi₂WO₆薄膜/电解液界面光电子复合、ITO 电极/电 解液界面光电子复合.

不同煅烧温度得到的薄膜光电流和光电转换量 子效率的差别可以从光吸收和光生电子的复合途径 角度来分析. 低温(450 ℃)煅烧得到的薄膜, Bi₂WO₆ 结晶相对较差,晶体表面和内部缺陷较多,在光的照 射下,光生电子的缺陷复合起主导作用,光电流较 小,光电转换量子效率较低;高温(550℃)煅烧得到 的薄膜,颗粒结晶更完善,但由于颗粒长大,同时颗 粒之间的间隙增大, ITO 电极/电解液界面光电子复 合几率增大,颗粒间隙的光透过率增大,使薄膜整体 吸光率减小,从而造成光电流减弱,光电转换量子效 率减小. 与 450 ℃的薄膜相比, 550 ℃的薄膜的颗粒 间隙对光电转换效率的影响超过了结晶的影响,所 以导致 550 ℃薄膜的光电转换效率反而比 450 ℃薄 膜的光电转换效率低. 对于 500 ℃煅烧得到的薄膜, 即能使 Bi₂WO₆结晶颗粒的缺陷减少, 又可以避免 由于颗粒生长过快造成颗粒间隙增大,因此,500℃ 煅烧得到的薄膜光电极光电流最强,光电转换效率 最高.

综合以上分析,对于 ITO/Bi₂WO₆ 薄膜光电极, 要得到大的光电流和高的光电转换效率,可以通过 控制薄膜的结构,促进 Bi₂WO₆结晶完善,减少晶体 缺陷,并抑制颗粒的快速生长来实现.另外,对 Bi₂WO₆ 薄膜光电极进行反复多次实验,光电流基本 保持不变,说明电极的光稳定性较好.

3 结 论

以非晶态配合物为前驱体,采用提拉法在 ITO

导电玻璃表面制备了 Bi₂WO₆ 薄膜, 薄膜的结构可 以通过改变煅烧温度来控制. 该 ITO/Bi₂WO₆ 薄膜 电极具有可见光响应, 在可见光照射下可以产生光 电流, 光电极的光电流强度和光电转换量子效率受 Bi₂WO₆ 薄膜结构的影响, 通过控制薄膜的制备条 件, 可以提高薄膜光电极的光电转换量子效率.

References

- 1 Tryk, D. A.; Fujishima, A.; Honda, K. *Electrochim. Acta*, **2000**, **45**: 2363
- 2 Ingler Jr., W. B.; Baltrus, J. P.; Khan, S. U. M. J. Am. Chem. Soc., 2004, 126: 10238
- 3 Sakai, N.; Ebina, Y.; Takada, K.; Sasaki, T. J. Am. Chem. Soc., 2004, 126: 5851
- 4 Torimoto, T.; Nagakubo, S.; Nishizawa, M.; Yoneyama, H. *Langmuir*, **1998**, **14**: 7077
- 5 Wang, H.; Lindgren, T.; He, J.; Hagfeldt, A.; Lindquist, S. E. J. Phys. Chem. B, 2000, 104: 5686
- 6 Khan, S. U. M.; Akikusa, J. J. Phys. Chem. B, 1999, 103: 7184
- 7 Kudo, A.; Hijii, S. Chem. Lett., 1999, (10): 1103
- 8 Tang, J. W.; Zou, Z. G.; Ye, J. H. Catal. Lett., 2004, 92: 53
- 9 Zhang, C.; Zhu, Y. F. Chem. Mater., 2005, 17: 3537
- 10 Fu, H. B.; Pan, C. S.; Yao, W. Q.; Zhu, Y. F. J. Phys. Chem. B, 2005, 109: 22432
- Zhang, S. C.; Zhang, C.; Man, Y.; Zhu, Y. F. J. Solid State Chem., 2006, 179(1): 62
- 12 Yu, J. G.; Xiong, J. F.; Cheng, B.; Yu, Y.; Wang, J. B. J. Solid State Chem., 2005, 178(6): 1968
- 13 Hamada, M.; Tabata, H.; Kawai, T. Thin Solid Films, 1997, 306: 6
- Ishikawa, K.; Watanabe, T.; Funakubo, H. *Thin Solid Films*, 2001, 392: 128
- Choy, J. H.; Kim, Y. I.; Kim, B. W.; Campet, G.; Portier, J.; Huong, P. V. J. Solid State Chem., 1999, 142: 368
- Vigreux, C.; Binet, L.; Gourier, D. J. Solid State Chem., 2001, 157: 94
- 17 Donoan, K. J.; Sudiwala, R. V.; Wilson, E. G. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 1991, 194: 337
- Pejova, B.; Tanusevskib, A.; Grozdanov, I. J. Solid State Chem., 2005, 178: 1786